

別表1 「光融合技術イノベーションセンター機器の利用要領（平成26年4月1日制定）」

光融合技術イノベーションセンター機器一覧 及び 学外者利用 料金表

光融合技術イノベーションセンター関連機器

平成29年4月1日より適用

装置名	利用条件等	学外者利用料金	
		基本使用料	操作委託料
電子ビーム描画装置 エリオニクス製 ELS-78000P	要共同研究等個別応談	10,000 円/時間	2,000 円/時間
短波長レーザー加工機 シグマ光機/コヒレントジャパン AviA 355-7HP	要共同研究等個別応談	2,500 円/時間	2,000 円/時間
ホログラフィックレーザー加工機 ・超短パルスレーザー コヒレントジャパン Micra-CEP ・3次元位置決め装置 ・ホログラム表示装置 ・光学定盤	要共同研究等個別応談	5,000 円/時間	2,000 円/時間
リアクティブイオンエッチング装置 (ICP-RIE) ULVAC 製 CE-300I	別途エッチングガス費 (200~600 円/L) ※	2,500 円/時間	2,000 円/時間
赤外域一多入射角分光エリブソメータ J. A. ウーラム ジャパン製 IR-VASE-UT		2,500 円/時間	3,000 円/時間
表面X線回折装置 (XRD) スペクトリス社製 X' Pert PRO MRD		2,500 円/時間	2,000 円/時間
光磁気効果測定超高感度磁力計 (VSM) レイクショア製 7404 型		2,500 円/時間	2,000 円/時間
干渉計測装置 Zygo 製 NewView7300		1,500 円/時間	2,000 円/時間
イオンエッチング装置 エリオニクス製 EIS-200ERU	要共同研究等個別応談	2,500 円/時間	2,000 円/時間
走査型プローブ顕微鏡 (SPM) 島津製作所 SPM-9600		1,500 円/時間	2,000 円/時間
波長分散型蛍光X線元素分析装置 リガク製 ZSX Primus II		2,500 円/時間	2,000 円/時間
レーザー顕微鏡 オリンパス製 OLS4000-SAT		1,500 円/時間	2,000 円/時間
表面形状測定器 (小型 SEM) 日立 Miniscope TM3000		2,500 円/時間	2,000 円/時間
(角度自動制御) 紫外可視赤外分光光度計 日本分光製 V-670		1,500 円/時間	2,000 円/時間
ラッピングマシーン 日本エンギス製 EJ200IN		1,500 円/時間	2,000 円/時間
多元スパッタ装置 富士 R&D	要共同研究等個別応談	5,000 円/時間	2,000 円/時間

備考 1 「基本使用料」+「操作委託料」+「消耗品代金（必要な場合）」+「利用登録料（必要な場合）」が利用料金の総額となります。

2 「基本使用料」は装置の実運転時間（もしくは機器予約時間）から算出されます。

3 「操作委託料」は機器管理者等が行う装置使用講習、前処理、後処理、装置操作及び測定後の解析作業などの実働時間から算出されます。従って「基本使用料」の算出時間と「操作委託料」の算出時間は異なります。

4 「消耗品代金」は試料の前処理や後処理、装置操作に必要な消耗品などから算出されます。

5 装置の利用条件等の制約上、装置の外部利用及び外部予約をお受けできないことがあります。

6 個別応談の結果、共同研究の一環として機器利用される場合、学外者利用料金は適用されない場合があります。

7 学外者利用料金は消費税込み料金で表示してあります。

※ 単価はガス種により異なります。